

CVI装置 CI-4500



CVI装置CI-4500は糸状のカーボン繊維を1200～1500℃に加熱して、CVD法により、カーボン膜やSiC膜を含浸させることのできる実験用CVI装置です。

CVI装置 CI-4500 仕様

○膜種	SiC/C
○炉体サイズ	φ30mm×1000mm
○炉体材質	SUS316
○基板形状	φ8mm×6000本/束
○到達圧力	×10 ⁻² Pa台※常温・無負荷・脱ガス時
○排気速度	×10 ⁻¹ Pa台迄3分以内※常温・無負荷・脱ガス時
○加熱温度	1500℃
○圧力コントロール	自動
○ガス種	SiCl ₄ /CH ₄ /N ₂ /H ₂
○電源	DC電源 150V 4.5kW 1台
○真空排気系	油回転ポンプ:260L/min メカニカルブースターポンプ:50m ³ /h
○真空計	ピラニ真空計/バラトロン真空計
○ユーティリティ	電気: AC200V三相30kVA 冷却水: 10L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環 計装エア: 0.5MPa以上